

柏第2キャンパス工学系共通機器利用のご案内

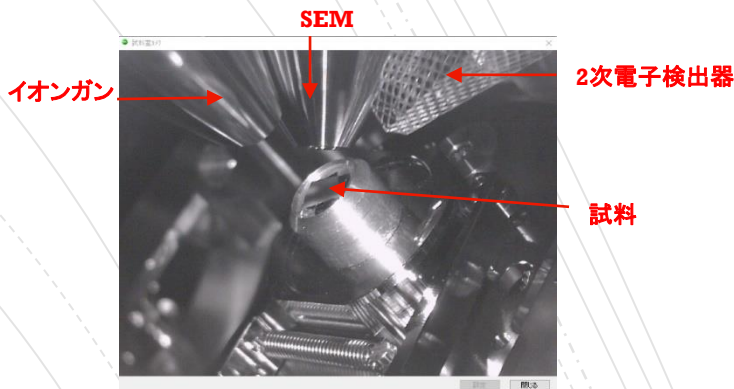
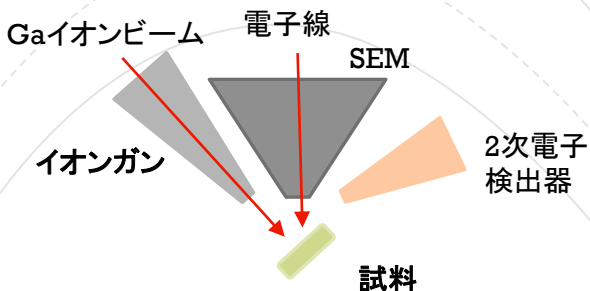
複合ビーム加工観察装置 JIB-4700F

■JIB-4700F (JEOL社FIB)

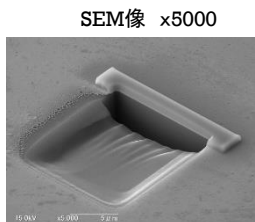
- ・ショットキー電界放出電子銃による高分解能SEM
- ・FIBイオンビーム電流: 1pA~90 nA: 大電流による高速加工
- ・エネルギー分散型X線分光 (EDS: Oxford): 大型検出器による高速組成分析
- ・電子後方散乱回折 (EBSD: Oxford Symmetry[®]): CMOSセンサによる高速測定
- ・SEM・EDS・EBSDの同時測定
- ・FIB加工とEDS/EBSD測定の自動繰り返しによる「3次元組成・方位マッピング」
- ・ベクタースキャンによる複雑形状のFIB加工
- ・用途に合わせた3種類(カーボン・タングステン・プラチナ)の保護膜デポ



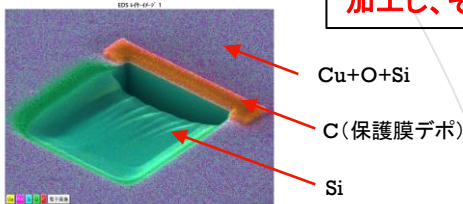
FIB



<加工例>



EDS



53° 傾斜した試料をGaイオンによりピンポイントで加工し、そのままSEM観察、EDS分析できます

EBSD

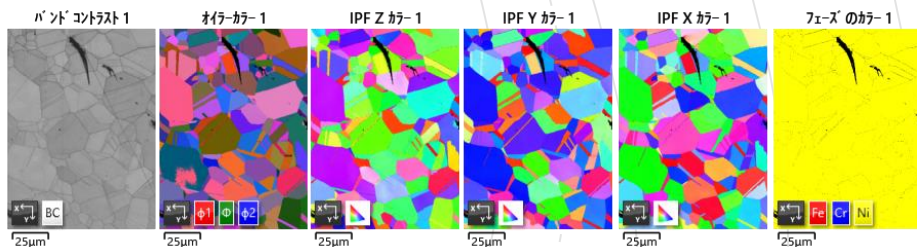
STEEL結晶方位の高速測定 領域: 100μm × 140μm ステップサイズ: 0.3μm 測定時間: 約5分!

試料ホルダ



貼り付け型

挟み込み型



料金表

☆代理測定もお受けいたします

利用料/hr	デモ料金/hr	代理測定料金/hr	講習料金/1回/1名
¥3,500	¥7,000	¥7,000	¥10,000

問い合わせ先

東京大学柏第2キャンパス 産学官民連携棟110号室 FE-SEM/FIB管理

植田 啓介

TEL 070-3121-1645

E-mail ueda.keisuke3495@mail.u-tokyo.ac.jp